

VDA QMC

Verband der Automobilindustrie
Qualitäts-Management-Center

19

Teil 1

Jetzt den Gelbband des
VDA 19.1 herunterladen

👉 [HIER](#)

Download the
VDA 19.1

👉 [HERE](#)



VDA 19.1 & PARTSENS 4.0

Apart from the new approach with a focus on process monitoring, the new version features additional methods:

- Direct inspection of surfaces
- Sampling with particle lift-off
- Characterization of materials as metallic
- White and transparent particle detection

Abgesehen vom neuen Ansatz mit Fokus auf Prozessüberwachung bietet die neue Version zusätzliche Funktionen:

- Direkte Oberflächeninspektion
- Partikelentnahme mittels Abheben (Lift-off)
- Charakterisierung von Materialien als metallisch
- Erkennung weißer und transparenter Partikel

All the above listed points are covered by the **PartSens 4.0** and Tape-Lift Pads. Electron microscopy has been elevated by the introduction of a base-line parameters which allow comparison of material characterization in the future. The possibility of using particles sampled with TapeLift media to directly analyze in SEM or LIBS speeds up the measurement process. Costs are reduced by avoiding intermediary steps of transfer and fixation.

Alle diese Punkte werden vom **PartSens 4.0** und den Tape-Lift Pads abgedeckt. Die Elektronenmikroskopie wurde durch die Einführung von Basisparametern verbessert, die künftig einen Vergleich bei der Materialcharakterisierung ermöglichen. Die Möglichkeit, mit Tape-Lift-Medien entnommene Partikel direkt im REM oder LIBS zu analysieren, beschleunigt den Messprozess und senkt die Kosten, da Zwischenschritte wie Transfer und Fixierung entfallen.

The latest PartSens 4.0 news



SPIE Conference: Space Systems Contamination: Prediction, Control, and Performance 2025 3-7 August 2025 - San Diego

For 5 days more than 20.000 engineers, scientists, and business managers gathered at the SPIE optics+photonics in San Diego, California. OMT and Sentry Sciences again participated and showcased solutions for contamination control of surfaces. The PartSens 4.0 was available for try-outs and testing on the exhibition floor. The highlight was the presentation of a measurement system capability study of the glancing light measurement method. In the "Space Contamination Control - Prediction, Control, and

SPIE-Konferenz: Space Systems Contamination: Prediction, Control, and Performance 2025 3.-7. August 2025 – San Diego

Über fünf Tage hinweg versammelten sich mehr als 20.000 Ingenieure, Wissenschaftler und Geschäftsleute auf der SPIE Optics+Photonics in San Diego, Kalifornien. OMT und Sentry Sciences waren erneut vertreten und präsentierten Lösungen zur Kontrolle von Oberflächenkontamination. Der PartSens 4.0 stand auf der Ausstellung für Vorführungen und Tests zur Verfügung. Das Highlight war die Vorstellung einer Studie der Messsystemfähigkeit der Streiflichtmethode auf der

Performance' conference. Capability was demonstrated in the lab and in an ongoing study of cleaning surfaces contaminated with moondust. (M. Schwierskott, M. Berdovich (2025) *Measurement Capability of Particle Size Analysis with Glancing Light*.) in print.

Additionally, engineers from the Aerospace Corporation presented an independent study of surface particle measurement methods. LIT: They examined the comparability of results of various lift-off materials and of a standard microscope set-up with the PartSens 4.0. Coming from the indirect determination of the particle concentration (as %PAC) via particle size, the presenter De-Ling Liu advocates direct measurement of the particle area. Comparing a standard desktop microscope which requires trained staff to the mobile PartSens 4.0 showed no significant differences. (De-Ling Liu*, Aldrich R De La Cruz (2025) *Real-time Surface Particulate Cleanliness Characterization*) in print.

Konferenz „Space Contamination Control – Prediction, Control, and Performance“. Die Messfähigkeit wurde im Labor sowie in einer laufenden Studie zur Reinigung von mit Mondstaub kontaminierten Oberflächen demonstriert. (M. Schwierskott, M. Berdovich (2025) *Measurement Capability of Particle Size Analysis with Glancing Light*) – im Druck.

Zusätzlich präsentierten Ingenieure der Aerospace Corporation (USA) eine unabhängige Studie zu Methoden der Oberflächenpartikelmessung. Sie untersuchten die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Abklatschmaterialien sowie eines Standard-Mikroskop-Setups mit dem PartSens 4.0. Ausgehend von der indirekten Bestimmung der Partikelkonzentration (als PAC) mittels Partikelgröße, plädiert die Vortragende Dr. De-Ling Liu für die direkte Messung der Partikelfläche. Der Vergleich eines Tischmikroskops, das geschultes Personal erfordert, mit dem mobilen PartSens 4.0 zeigte keine signifikanten Unterschiede. (De-Ling Liu*, Aldrich R. De La Cruz (2025) *Real-time Surface Particulate Cleanliness Characterization*) – im Druck.

**Mehr Infos zum
PartSens 4.0 gibt's auf
unserer Website!**

Hier  

**For more info on the
PartSens 4.0, check our
website!**

Here  

PMT Partikel-Messtechnik GmbH

Schafwäsche 8, 71296, Heimsheim

Tel: 07033 5374 - 0

www.pmt.eu – info@pmt.eu

Privacy Notice in accordance with the GDPR

We treat your personal data confidentially and in accordance with legal data protection regulations as well as this privacy policy. For more information, please refer to our [privacy policy](#).

Unsubscribe from the Newsletter

If you no longer wish to receive the newsletter, you can unsubscribe at any time via the following link: [Unsubscribe here](#).

